

レーザー協会 第199回研究会

「ビーム計測・プロセスモニタリング技術の最新動向」

開催日時: 令和6年5月22日(水) 14:30~17:00

会場: 中央大学理工学部6号館4階6429室

(東京都文京区春日1-13-27、最寄駅: 後樂園、春日、水道橋)

開催形式: 対面形式



研究会主旨: レーザ発振器の多様化と高出力化、加工システムの高度化に伴い、ビームの計測技術、プロセスモニタリング技術の重要性がより一層増えています。本研究会では「ビーム計測・プロセスモニタリング技術の最新動向」と題し、3件の講演を予定しています。レーザービーム特性評価、プロセスモニタリングに関する最新レーザー技術を紹介頂きます。万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

14:30~14:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長

14:35~15:20 **講演1**

「自動車、車載バッテリー業界における最新レーザーパラメータ管理」

PRIMES Japan 株式会社 佐倉 正和氏

15:20~16:05 **講演2**

「レーザー溶接モニタリング技術」

株式会社 NISHIHARA 川上 佳剛氏

16:05~16:50 **講演3**

「量産に使用されているモニタリング装置」

プレシテック・ジャパン株式会社 中辻 雅博氏

16:50~17:00 **閉会挨拶**

レーザー協会副会長

【参加費】 会員: 無料 非会員: 7,000 円

【申込先】 レーザ協会 Web ページ <http://jslt.jp/> からお申し込み下さい。

・参加申込〆切: 令和6年5月15日(水)

【問合せ先】 レーザ協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp